

投資者關係：
Ed Lockwood
投資者關係資深總監
(408) 875-9529
ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：
Meggan Powers
企業宣傳資深總監
(408) 875-8733
meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-TENCOR 推出 KLARITY® LED 缺陷分析系統和 ICOS® WI-2220 LED 晶圓檢測儀來協助製造商降低成本

KLA-Tencor 推出旨在提升 LED 設備代工廠產能的多種製程控制解決方案

- 新的 **KLARITY LED** 為 LED 良率改善和更快取得結果提供自動缺陷分析
- 新的 **ICOS WI-2220** 提供更低的擁有成本，以支援 LED 產業的每流明成本目標

【加州 MILPITAS 2011 年 1 月 20 日訊】今天，專為半導體和相關產業提供製程控制與良率管理解決方案的全球領先供應商 [KLA-Tencor Corporation](http://www.kla-tencor.com) (NASDAQ: KLAC) 推出了用於改善發光二極體 (LED) 良率的自動分析與缺陷資料管理系統—— KLARITY® LED，以及專為 LED 缺陷檢測而設計，協助 LED 設備製造商降低其生產成本，同時增加 LED 設備可靠性的晶圓檢測工具——新的、可擴展的 ICOS® WI-2220。

KLA-Tencor 的成長與新興市場事業群副總裁 Jeff Donnelly 稱：「業界目前普遍預計，LED 市場在 2013 年前將以 25% 或更高的複合年成長率保持成長。如今，LED 設備製造商面臨著以更低成本提供更高效能的挑戰，同時還要支援這個產業咄咄逼人的成長率。KLA-Tencor 全面的系列 LED 缺陷檢測與分析解決方案旨在為 LED 生產降低每流明成本，同時實現更嚴苛的製程控制和總體良率改善。」

KLARITY LED：用於改善 LED 良率的缺陷分析與資料管理系統

新的 KLARITY LED 建立在積體電路製造中使用的業界領先的 KLARITY Defect 產品基礎之上，能夠為 LED 設備製造商提供高效能解決方案，包括用於整個代工廠生產程序的自動線內掃描分析。LED 產業從傳統的以工具為中心的人工缺陷檢查開始起步（當時只在生產線終端階段才有自動光學檢測），正朝著採用尖端的全廠製程控制與線內檢測缺陷分析的方向發展。由於前端與後端相互連通，KLARITY LED 提供了比業界常用方法更快的偏移偵測與根源分析，以實現有效的決策制定，從而有助於降低材料風險的影響，並改善良率。憑藉 KLARITY LED，KLA-Tencor 向 LED 設備製造商推出了先進的線內替代解決方案，以實現 LED 生產程序的自動缺陷分析，並讓他們可以選擇更高效地在其組織內分享效能與可靠性資料，以加快良率學習，同時取代了現行費力的人工報告產生方法。

KLARITY LED 旨在協助 LED 設備製造商加快良率學習週期，並推動採取立即校正措施，它包括：

- 自動分析（智慧統計製程控制偏移與基線監測）— 不再像以前那樣必需專家介入和解釋，而是以自動情況報告、廣泛的深入分析能力和實用決策流分析，為更快的校正措施提供支援

（待續）

KLA-TENCOR 推出 KLARITY® LED 和 ICOS® WI-2220 LED 晶圓檢測儀

- 先進的缺陷來源分析 — 針對缺陷來源自動執行根源分析程序，為常見和附加缺陷提供靈活的圖形分析
- 專有的空間特徵分析 — 識別空間特徵，追蹤動態特徵計數，並借助層積晶圓特徵來查找根源，以更快地完成偵測與校正措施
- 缺陷圖像檢查 — 提供晶圓圖點選式存取以及一個圖像庫，讓設備製造商能夠對分類與缺陷過渡共性識別進行驗證，並迅速產生自動報告
- 重複缺陷偵測 — 在單個晶圓以及各個晶圓上識別重複缺陷

KLARITY LED 讓 KLA-Tencor 的晶圓檢測系統更加完備，包括新的 ICOS WI-2220，為關鍵 LED 檢測投資提供了更強大的針對 LED 的一系列解決方案。

ICOS WI-2220：LED 製程控制中的可擴展缺陷檢測與改善的擁有成本

ICOS WI-2220 的自動光學檢測功能可以協助 LED 設備製造商提升良率，並降低生產成本。利用 ICOS WI-2220，設備製造商可以對難以進行人工檢測的較小尺寸晶粒和需要快速校正措施以限制昂貴的材料風險的更大尺寸晶粒進行自動檢測。新系統允許對高達 200mm 的完整的和已切割的晶圓進行缺陷檢測，並且在 LED 晶圓的切割前和切割後檢測（即前端和後端）中具備宏觀檢測靈敏度。

與當今市場上的類似產品相比，ICOS WI-2220 提供了對關鍵缺陷的靈敏度——同時將由於製程變化帶來的雜訊降到最低——並以極高的檢測速度提供了較為突出的和損害較小的效能（晶粒誤分類）。此外，由於新系統採用新的專有檢測與資料處理技術，因此其圖像失真度低，光學過濾技術先進，採取基於規則的分類 (RBB) 進行即時自動缺陷分類，量測功能先進，且檢測吞吐量高。透過良率基線改善、偏移控制以及輸出品質控制檢測中的改進配置，這使提升製造程序中的良率成為現實。

ICOS WI-2220 與 Candela LED 非曝光成像晶圓檢測系統相配合，可以為前沿產品線提供全面的、改善良率的檢測範圍，包括分析配置、降低缺陷和控制偏移。另外，ICOS WI-2220 還可以升級到 [ICOS WI-2250](#)，以獲得更靈活的組態。

KLA-Tencor 的 ICOS WI-Series 晶圓檢測儀的全套 LED 系列產品、新的 KLARITY LED 良率管理系統和 Candela 系統將在 2011 年韓國國際 LED 展覽會 (LED Korea 2011) 上展出，該展覽會將於 2011 年 1 月 26~28 日在首爾 Coex 國際會展中心與韓國半導體工業技術展覽會 (Semicon Korea) 聯合舉辦。所有設備均由 KLA-Tencor 的全球綜合服務網路提供支援。若要瞭解更多資訊，請參觀網站 www.kla-tencor.com。

關於 KLA-Tencor：KLA-Tencor Corporation 是製程控制與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、資料儲存、LED、光電及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，三十餘年來為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州 Milpitas，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 www.kla-tencor.com。(KLAC-P)

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 KLARITY LED、ICOS WI-2220 和 Candela 系統的預期效能，高亮度發光二極體產業的未來發展與趨勢，包括預期成長率和製程控制與缺陷分析技術的變化（及其帶來的預期挑戰與成本），KLA-Tencor 的客戶對 KLARITY LED、ICOS WI-2220 和 Candela 系統的預期使用，以及 KLARITY LED、ICOS WI-2220 和 Candela 系統的使用者可以實現的預期成本、營運與其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品或其他技術，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###